

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 26 日 (2006.1.26)

【公表番号】特表 2005-514014 (P2005-514014A)

【公表日】平成 17 年 5 月 19 日 (2005.5.19)

【年通号数】公開・登録公報 2005-019

【出願番号】特願 2003-555173 (P2003-555173)

【国際特許分類】

C 1 2 Q 1/68 (2006.01)

C 1 2 M 1/00 (2006.01)

G 0 1 N 1/10 (2006.01)

G 0 1 N 1/34 (2006.01)

G 0 1 N 33/48 (2006.01)

G 0 1 N 37/00 (2006.01)

G 0 1 N 1/28 (2006.01)

【F I】

C 1 2 Q 1/68 Z

C 1 2 M 1/00 A

G 0 1 N 1/10 C

G 0 1 N 1/34

G 0 1 N 33/48 A

G 0 1 N 37/00 1 0 1

G 0 1 N 1/28 J

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 11 月 28 日 (2005.11.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

生体サンプル混合物から、負に帯電した小さい有機分子を除去する方法であって、
負に帯電した高分子電解質で部分的に被覆された第四級アンモニウムイオンを含む表面
を提供するステップと、
生体サンプル混合物を提供するステップと、
前記生体サンプル混合物を、前記負に帯電した高分子電解質で部分的に被覆された第四
級アンモニウムイオンを含む表面と接触させて、前記生体サンプル混合物から前記負に帯
電した小さい有機分子の少なくとも一部を除去するステップと、
を含む方法。

【請求項 2】

生体サンプル混合物から、負に帯電した小さい有機分子を除去する方法であって、
負に帯電した高分子電解質で部分的に被覆された第四級アンモニウムイオンを含む表面
を含む少なくとも 1 つのプロセスアレイを含むデバイスを提供するステップと、
生体サンプル混合物を、前記少なくとも 1 つのプロセスアレイ内に提供するステップと
、
前記生体サンプル混合物を、前記少なくとも 1 つのプロセスアレイ内で移動させるステ
ップであって、前記生体サンプル混合物から、前記負に帯電した小さい有機分子の少なく

とも一部を除去するのに十分な時間、前記生体サンプル混合物および前記負に帯電した高分子電解質で部分的に被覆された第四級アンモニウムイオンを含む表面が接触したままであるステップと、
を含む方法。

【請求項 3】

生体サンプル混合物から、負に帯電した小さい有機分子を除去する方法であって、
負に帯電したポリマーで部分的に被覆された陰イオン交換材料を含む表面を提供するステップと、
生体サンプル混合物を提供するステップと、
前記生体サンプル混合物を、前記負に帯電したポリマーで部分的に被覆された陰イオン交換材料を含む表面と接触させて、前記生体サンプル混合物から前記負に帯電した小さい有機分子の少なくとも一部を除去するステップと、
を含む方法。

【請求項 4】

生体サンプル混合物から、負に帯電した小さい有機分子を除去する方法であって、
負に帯電したポリマーで部分的に被覆された陰イオン交換材料を含む表面を含む少なくとも 1 つのプロセスアレイを含むデバイスを提供するステップと、
生体サンプル混合物を、前記少なくとも 1 つのプロセスアレイ内に提供するステップと、
、
前記生体サンプル混合物を、前記少なくとも 1 つのプロセスアレイ内で移動させるステップであって、前記生体サンプル混合物から、前記負に帯電した小さい有機分子の少なくとも一部を除去するのに十分な時間、前記生体サンプル混合物および前記負に帯電したポリマーで部分的に被覆された陰イオン交換材料を含む表面が接触したままであるステップと、
を含む方法。